

実験・研究用マスクアライナー

ES410

LOW COST

ESシリーズ 低価格セットアップ

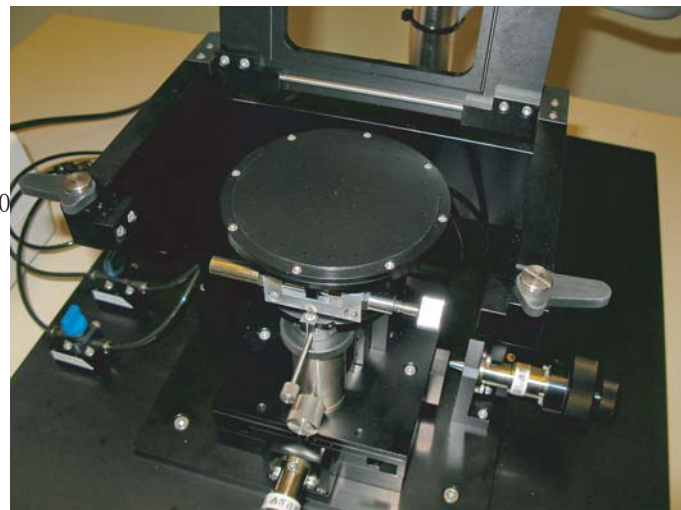
ローコストながらフォトリソグラフィに必要な十分な機能を持ったマスクアライナーです。フルマニュアル機で各種実験、研究、フォトリソグラフィの学習などにご使用頂けます。ESシリーズならではの幅広いカスタマイズ性を備え、各種ユニットやオプションを選択することで、さらに目的にフィットした装置にセットアップ可能です。ほとんどのユニットが後から追加・変更できますので将来のグレードアップにも対応致します。



(標準仕様: コリメータレンズUV光源、実体顕微鏡観察タイプ)

◆仕様

形式	等倍片面露光式マスクアライメント装置
露光方式	1:1等倍露光 コンタクトおよびプロキシミティ
適応試料	最大φ4インチ 厚さ 3mm 以内 各サイズとも試料台の変更により対応可能
固定方式	真空吸着式
適応マスク	最大□5インチ 厚さ 0.06 または 各サイズともマスクホルダの変更により対応可能
固定方式	真空吸着式
マスクホルダ	ヒンジ開閉式(メカロック付き)
アライメント	マスク固定、ウェハXYZθ軸ステージ移動
XY軸	±5mm 手動(微動・粗動ハンドル付)
Z軸粗動	15mm 手動ネジ止め式
Z軸微動	±125μm 手動 微動レバー
Z軸位置測定	Z軸高さ測長器 分解能1μm(オプション)
θ軸ストローク	±7° 手動 微動
レベル調整	球面摺動方式 真空吸着式固定
真空操作	手動ハンドバルブ
UV露光光学系	コリメータレンズ方式ランプハウス
有効露光範囲	φ70mm 以上
主波長	λ = 365, 405, 436nm
使用ランプ	超高圧 Hgランプ 250W
UV照度	約6mW/cm ² 以上、±15%以内(at 365nm)
露光解像度	ライン&スペース 2~3μm程度 (最小線幅は露光前後工程等諸条件により異なります)
露光量設定	UV光源電源内蔵タイマー設定
観察光学系	実体顕微鏡 総合倍率7~45倍程度
観察照明	ハロゲンランプ&リングファイバー照明。 不要露光防止(イエローフィルター)内蔵
寸法・重量	700(H)×460(W)×540(D)mm、100Kg 以下
ユーティリティ	電源 AC100V 10A 以内、真空 600mmHg以上



販売元

製造元

SANMEI GROUP IDENTITY

sanmei 株式会社 三明

〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16
電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201 電話 (03)3960-3171 Fax (03)3960-3174